



一种用于积分腔光谱技术同位素分析的温度精确控制装置

文献类型：专利

.....

作者 张志荣¹; 崔小娟¹; 庞涛¹; 吴边¹; 夏涓¹

发表日期 2014-12-02

专利国别 中国

专利类型 发明

权利人 中国科学院

公开日期 2014-12-02

申请日期 2013

专利申请号 201310039844.2

源URL [<http://ir.hfcas.ac.cn/handle/334002/12582>]

专题 合肥物质科学研究院_中科院安徽光学精密机械研究所

推荐引用方式 张志荣,崔小娟,庞涛,等. 一种用于积分腔光谱技术同位素分析的温度精确控制装置,一种用于积分腔光谱技术同位素分析的温度精确控制装置,一种用于积分腔光谱技术同位素分析的温度精确控制装置,一种用于积分腔光谱技术同位素分析的温度精确控制装置,一种用于积分腔光谱技术同位素分析的温度精确控制装置,一种用于积分腔光谱技术同位素分析的温度精确控制装置,一种用于积分腔光谱技术同位素分析的温度精确控制装置,一种用于积分腔光谱技术同位素分析的温度精确控制装置,一种用于积分腔光谱技术同位素分析的温度精确控制装置,一种用于积分腔光谱技术同位素分析的温度精确控制装置. 2014-12-02.

入库方式：OAI收割

来源：[合肥物质科学研究院](#)

浏览
149

下载
9

收藏
0

其他版本

除非特别说明，本系统中所有内容都受版权保护，并保留所有权利。